

488696-2026 - Verseny

Írország – Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok - Változtatásról szóló hirdetmény

Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Education Procurement Service (EPS)

E-mail-cím: info@educationprocurementservice.ie

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Leírás: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Eljárásazonosító: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

2.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): South-East (IE052)

Ország: Írország

2.1.3. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.5. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 4

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizáráásra forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Leírás: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Belső azonosító: 1

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): South-East (IE052)

Ország: Írország

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 48 Hónapok

5.1.5. Érték

A becsült érték hea (áfa) nélkül: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: angol

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem hivatalosan elérhetők: angol

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: angol

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Hely: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: The High Court of Ireland

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Education Procurement Service (EPS)

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: The High Court of Ireland

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Rész: LOT-0002

Cím: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Leírás: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Belső azonosító: 2

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

5.1.2. A teljesítés helye

Ország aleggysége (NUTS): South-East (IE052)

Ország: Írország

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 48 Hónapok

5.1.5. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: angol

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem hivatalosan elérhetők: angol

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: angol

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Hely: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: The High Court of Ireland

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Education Procurement Service (EPS)

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: The High Court of Ireland

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Rész: LOT-0003

Cím: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Leírás: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Belső azonosító: 3

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): South-East (IE052)

Ország: Írország

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 48 Hónapok

5.1.5. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: angol

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem hivatalosan elérhetők: angol

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: angol

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Hely: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: The High Court of Ireland

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Education Procurement Service (EPS)

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Rész: LOT-0004

Cím: Plasma Deposition ,PECVD

Leírás: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Belső azonosító: 4

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): South-East (IE052)

Ország: Írország

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 48 Hónapok

5.1.5. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem hivatalosan elérhetők: angol

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: angol

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Hely: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: The High Court of Ireland

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: Education Procurement Service (EPS)

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: The High Court of Ireland

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

Ajánlatokat feldolgozó szervezet: Education Procurement Service (EPS)

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Education Procurement Service (EPS)

Regisztrációs szám: IE 6609370 G

Postacím: Castletroy Limerick
Város: Limerick
Írányítószám: V94 DK53
Ország alegysége (NUTS): Mid-West (IE051)
Ország: Írország
E-mail-cím: info@educationprocurementservice.ie
Telefonszám: 000
Internetcím: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
Az ajánlatkérő szervezet profilja: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet
Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: The High Court of Ireland
Regisztrációs szám: The High Court of Ireland
Szervezeti egység: The High Court of Ireland
Postacím: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Város: Dublin
Írányítószám: D07 WDX8
Ország alegysége (NUTS): Dublin (IE061)
Ország: Írország
E-mail-cím: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefonszám: +353 1 8886000
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: European Dynamics S.A.
Regisztrációs szám: 002024901000
Szervezeti egység: European Dynamics S.A.
Város: Athens
Írányítószám: 15125
Ország alegysége (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Ország: Görögország
E-mail-cím: eproc-esender@eurodyn.com
Telefonszám: +30 2108094500
E szervezet szerepei:
TED eSender

10. Változtatás

Az előző hirdetmény módosítandó változata
:
46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01
A változtatás fő oka
:

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: angol

A hirdetmény közzétételi száma: 488696-2026

HL S kiadás száma: 134/2026

A közzététel dátuma: 15/07/2026